

# PLD 使用記録表

作製：長島しよーご

月 日 ( )	: ~ :	使用者	
サンプルナンバー			
バックグラウンド圧力		Pa	
製膜時圧力		Pa	
ターゲット			
ターゲット - 基板 距離		500 mm	
レンズ位置		150 mm	
基板			
レーザー出力		J	
アッテネータ		°	
レーザーエネルギー密度		$J \cdot cm^{-2}$	
レーザー窓前エネルギー		mJ	
製膜時間		min	
基板温度		°C	
TMP 回転数		Hz	
導入ガス			
ガス流量		sccm	
ガス圧		Pa	
累計フラッシュランプ使用時間		$\times 10^6$ パルス	
フラッシュランプ使用時間上限		19.97 $\times 10^6$ パルス	

備考